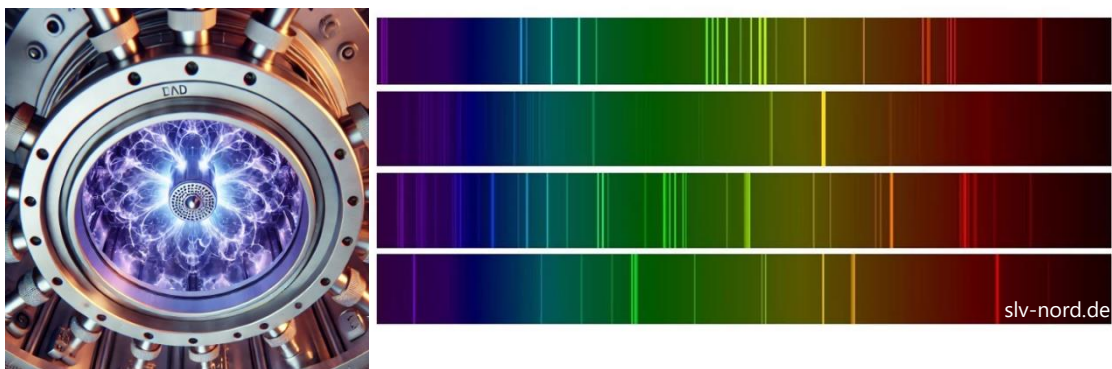




Entwicklung eines Emissionsspektrometers für die Plasmaanalyse in PVD/PECVD-Prozessen

(Bachelorarbeit, Teamprojektarbeit, Masterarbeit, Projektstudium)

Hintergrund: Die Beschichtung von Bauteilen und Werkzeugen ist eine effektive Methode, um Verschleiß und Reibung in technischen Systemen zu reduzieren. Mit steigenden Anforderungen an die verwendeten Schichtsysteme ist dabei zunehmend ein tiefes Verständnis der komplexen Beschichtungstechnologie erforderlich. Im Rahmen dieser Arbeit soll ein einfaches Emissionsspektrometer entwickelt werden, um die Metallionenkonzentration im Plasma abschätzen zu können.



Inhalte der Arbeit:

- Entwicklung eines Sensors mit Anlagenintegration
- Validierung an einer PVD/PECVD-Anlage

Die finale Aufgabenstellung werden wir abhängig von deinen persönlichen Interessen und dem aktuellen Forschungskontext gemeinsam festlegen. Der Umfang der Arbeit wird an BA, MA etc. angepasst.

Ansprechpartner:

Christian Orgeldinger, M.Sc.

Raum: 1.32 (FAN C)

Telefon: 0921 55-7296

E-Mail: christian.orgeldinger@uni-bayreuth.de

